

第10回専門講習会

「プロセスプラズマの計測法とその最新応用」

目 次

1. プラズマ計測法の基礎		
1.1 粒子的測定法	菅井秀郎	1
1.2 光学的測定法 I. (主として可視・紫外域)	門田清	25
1.3 光学的測定法 II. (主として赤外域)	河野明廣	45
2. 計測応用トピックス		
2.1 フロンECRプラズマの ラジカル計測とエッチング制御	堀勝	67
2.2 塩素ICPパルスプラズマの 計測とノッチ抑制	中村圭二	89
2.3 シラン高密度プラズマの 計測と薄膜の低温形成	豊田浩孝	107